

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
【発行日】令和 2 年 2 月 20 日 (2020.2.20)

【公開番号】特開 2018-195725 (P2018-195725A)  
【公開日】平成 30 年 12 月 6 日 (2018.12.6)  
【年通号数】公開・登録公報 2018-047  
【出願番号】特願 2017-98913 (P2017-98913)  
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/66 (2006.01)

G 0 1 R 31/26 (2020.01)

G 0 1 K 11/12 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/66 T

G 0 1 R 31/26 Z

G 0 1 K 11/12 B

【手続補正書】

【提出日】令和 1 年 12 月 25 日 (2019.12.25)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2】

前記検査装置を複数有し、前記搬送装置は、前記基板および前記温度測定基板を各検査装置のステージに搬送することを特徴とする請求項 1 に記載の検査システム。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1 4】

前記検査システムは、前記検査装置を複数有し、前記搬送装置は、前記温度測定基板を各検査装置のステージに搬送して前記温度測定基板の温度を測定することを特徴とする請求項 1 3 に記載の検査システムにおける温度測定方法。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1 6】

前記温度測定基板は、前記温度測定部材が基材上に形成されてなることを特徴とする請求項 1 3 から請求項 1 5 のいずれか 1 項に記載の検査システムにおける温度測定方法。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 3】

上記第 1 および第 2 の観点において、前記検査装置を複数有し、前記搬送装置は、前記基板および前記温度測定基板を各検査装置のステージに搬送するようにしてもよい。